

Nome (Tipo) apparecchiatura	Microscopio elettronico
Fornitore	ZEISS
Costruttore	ZEISS
Modello	SIGMA 500
Descrizione breve	<p>Microscopio elettronico con sorgente ad emissione di campo (Field Emission Scanning Electron Microscope, FE-SEM) corredato di sistemi di microanalisi EDS ed analisi cristallografica EBSD</p>
Website	<p>https://www.zeiss.com/microscopy/int/products/scanning-electron-microscopes/sigma.html</p>
Altre caratteristiche / funzionalità disponibili	<ul style="list-style-type: none"> - ZEISS SIGMA 500 (Colonna elettro-ottica Gemini, Sorgente di emissione ad effetto di campo tipo Schottky, Tavolino portacampioni eucentrico motorizzato su cinque assi, Sistema di imaging avanzato, Software SmartSEM per l'acquisizione e la gestione delle immagini con funzione Image Navigation per Microscopia Correlativa) - Microanalisi EDS (Energy Dispersive X-ray Spectrometry) OXFORD Altee Energy - Advanced per rilevamento caratteristiche morfologiche e di composizione chimica - Sistema EBSD (Electron Backs-Scattered Diffraction) AZTEC HKL per analisi cristallografiche
Riferimento scientifico	Vedani Maurizio - maurizio.vedani@polimi.it
Riferimento operativo	Pardi Maurizio - maurizio.pardi@polimi.it / Rovatti Ludovica - ludovica
Modalità di gestione	Dipartimento
	